

除害装置・チラー装置

●除害装置 メーカー：UNISEM

- 除害方式：燃焼方式、プラズマ方式、ヒーター方式、乾式方式など各種。

装置概要：半導体及び液晶製造装置から排出される有毒ガス（可燃性ガス）を、例で挙げた様々な方式で除去する装置です。有毒ガスが十分に除去された状態で工場側のダクトへ排出するシステムです。

●チラー装置 メーカー：UNISEM

- 装置概要：半導体プロセスの中で、主に Etching（エッチング）工程で Process Chamber 内の温度を安定させる装置です。

LCD、LED、太陽電池等の工程にも対応可能です。

1. PCS8000（省エネモデル）
負荷可変型圧縮機、仕様に適したポンプによる省電力化。
2. GPD3000Z（冷媒式）
Coolant を使用せずに冷媒による熱交換方式の Chiller です。

製品イメージ

